

# 分析計測センター 機器利用料金表 2024(令和6)年度

学内用

下記の機器利用料金に 電気料金(¥150/時間) が加算されます

機器No.	機器名	機器利用料金(時間単価)			備考
		自己測定	時間外 自己測定 × 1.5	依頼・ 講習 × 2	
61	電界放出形電子線マイクロアナライザ FE-EPMA JEOL JXA-iHP200F	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
2	グロー放電発光分析装置 GD-OES Horiba GD-Profler2	¥1,500	¥2,250	¥3,000	
62	全自動光電子分光装置 XPS/UPS Thermo Fisher Scientific Nexsa	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
3	X線光電子分光装置 XPS JEOL JPS-9010TR	¥700	¥1,050	¥1,400	
4	オージェ電子分光装置 AES JEOL JAMP-9500F	¥1,500	¥2,250	¥3,000	
83	フーリエ変換赤外分光装置 FT-IR Shimadzu IRTracer-100	¥900	¥1,350	¥1,800	
5	フーリエ変換赤外分光装置 FT-IR JASCO FT/IR-4100	¥400	¥600	¥800	
6	レーザーラマン分光装置 LRS JASCO NRS-7200	¥700	¥1,050	¥1,400	
29	冷却加熱レーザーラマン分光光度計 LRS Tokyo Instruments NanofinderFlex	¥700	¥1,050	¥1,400	低温測定時 液体窒素代(実費)が追加
72	紫外可視近赤外分光光度計 UV-Visible/NIR JASCO V-770	¥400	¥600	¥800	
73	分光蛍光光度計 FL JASCO FP-8550	¥400	¥600	¥800	
7	電子スピン共鳴分光装置 ESR JEOL JES-RE2X	¥200	¥300	¥400	
9	In-plane型X線回折装置 In-plane XRD Rigaku SmartLab 9kW	¥800	¥1,200	¥1,600	
68	低温X線回折装置 Low temperature XRD Rigaku SmartLab 9kW	¥800	¥1,200	¥1,600	低温測定時 液体窒素代(実費)が追加
8	粉末X線回折装置 Powder XRD Rigaku SmartLab 3kW	¥700	¥1,050	¥1,400	
77	蛍光X線分析装置 XRF Rigaku ZSX Primus III+	¥700	¥1,050	¥1,400	
10	蛍光X線分析装置 XRF Rigaku ZSX Primus II	¥700	¥1,050	¥1,400	
57	ICP発光分光分析装置 ICP-OES Shimadzu ICPE-9820	¥1,500	¥2,250	¥3,000	
58	原子吸光分光光度計 AAS Shimadzu AA-7000	¥600	¥900	¥1,200	
64	熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計 GC-TOF-MS JEOL JMS-T200GCx-plus	¥800	¥1,200	¥1,600	熱分解ユニット利用時 試料カップ代(実費)が追加
40	電界放出形透過電子顕微鏡 FE-TEM JEOL JEM-2100F	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
11	透過電子顕微鏡 TEM Hitachi HT7700	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
12	冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡 Cold FE-SEM Hitachi SU8230	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
79	冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡 Cold FE-SEM Hitachi SU8000	¥1,000	¥1,500	¥2,000	
66	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 Schottky FE-SEM JEOL JSM-IT800 (SHL)	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
53	走査電子顕微鏡 SEM Hitachi FlexSEM1000 II	¥800	¥1,200	¥1,600	
54	cryo走査電子顕微鏡 cryo SEM JEOL JSM-IT200	¥800	¥1,200	¥1,600	通常ステージ利用時 cryoステージ利用時。依頼分析のみ
				¥2,000	

# 分析計測センター 機器利用料金表 2024(令和6)年度

学内用

下記の機器利用料金に 電気料金(¥150/時間) が加算されます

機器No.	機器名	機器利用料金(時間単価)			備考
		自己測定	時間外 自己測定 × 1.5	依頼・ 講習 × 2	
13	卓上走査電子顕微鏡 Desktop SEM Hitachi TM3030Plus	¥500	¥750	¥1,000	
55	卓上走査電子顕微鏡 Benchtop SEM JEOL JCM-6000Plus	¥600	¥900	¥1,200	
65	X線マイクロCTスキャン X-Ray CT Bruker SkyScan1172	¥2,000	¥3,000	¥4,000	
75	ナノ3D光干渉計測システム CSI Hitachi VS1800	¥500	¥750	¥1,000	
78	走査プローブ顕微鏡 SPM Hitachi E-sweep	¥400	¥600	¥800	
67	複合ビーム加工観察装置 FIB/FE-SEM JEOL JIB-4700F	¥2,500	¥3,750	¥5,000	
37	集束イオンビーム加工装置 FIB Hitach FB2200	¥2,500	¥3,750	¥5,000	
56	イオンミリング Ion Milling Machine Hitachi IM4000Plus	¥500	¥750	¥1,000	断面ミリング時 マスク代(¥1,000/回)が追加
60	SEM用イオンミリング装置 SEM Mill Fischione Instruments Model1061	¥500	¥750	¥1,000	
59	ウルトラマイクロトーム Ultramicrotome Leica EM UC7	¥800	¥1,200	¥1,600	
82	レーザー回折式粒度分布計 LD Malvern Panalytical Mastersizer3000	¥400	¥600	¥800	
76	粒度分布/ゼータ電位計 DLS Malvern Panalytical Zetasizer Pro	¥400	¥600	¥800	
42	比表面積・細孔分布測定装置 BET/BJH Shimadzu TriStar3000	¥300	¥450	¥600	
80	熱重量/示差熱測定装置 TG/DTA Rigaku TG-DTA8122	¥400	¥600	¥800	
81	示差走査熱量計 DSC Rigaku DSCvesta2	¥400	¥600	¥800	低温測定時 液体窒素代(実費)が追加
63	イオン化エネルギー測定装置 IE Bunkoukeiki BIP-KV100J	¥800	¥1,200	¥1,600	
18	白金コーター Pt Coater JEOL JEC-3000FC	-	-	-	センター機器を利用しない場合 1回あたり ¥200
19	金コーター Au Coater Sanyu Electron SC-701MC	-	-	-	センター機器を利用しない場合 1回あたり ¥200
20	カーボンコーター C Coater Vacuum Device VC-100	-	-	-	センター機器を利用しない場合 1回あたり ¥200
74	オスmiumコーター Os Coater Meiwafosis Tennant20	¥200	-	-	1回あたりの価格
84	親水化処理装置 PIB Vacuum Device PIB-20	-	-	-	センター機器を利用しない場合 1回あたり ¥200
85	超音波ホモジナイザー Homogenizer Nippon Seiki US-300AT	-	-	-	センター機器を利用しない場合 1回あたり ¥200
14	マイクロ天秤 Microbalance Mettler Toledo XP56	-	-	-	
15	クリーンルーム CR	¥300	¥450	¥600	
86	3D X線顕微鏡 XRM Bruker SkyScan1272	¥2,000	¥3,000	¥4,000	